GaN based III-V compound semiconductor light-emitting device

Patent number: TW475276 (B)
Publication date: 2002-02-01

Inventor(s): HO JIN-KUO [TW]; PAN SHYI-MING [TW]; CHIU CHIEN-CHIA [TW]

Applicant(s): IND TECH RES INST [TW]

Classification:

- international: *H01L33/00*; H01L33/00; (IPC1-7): H01L33/00

- european:

Application number: TW20000123451 20001107 **Priority number(s):** TW20000123451 20001107

Abstract of TW 475276 (B)

A GaN based III-V compound semiconductor light-emitting device comprises a p-type electrode and an n-type electrode disposed on the opposite surfaces of an n-type transparent semiconductor substrate. The p-type electrode is a mirror electrode and reflects light generated by the light-emitting device. The manufacturing process is thus simplified and the light-emitting efficiency of the light-emitting device is increased. In addition, sides of the n-type transparent semiconductor substrate can be slopes, and an electrode contact surface and sides of the n-type semiconductor substrate can be roughened to minimize internal total reflection of the GaN LED and to further increase the light-emitting efficiency.

Data supplied from the *esp@cenet* database — Worldwide

久 告 本 申請日期: (9)

(以上各欄由本局填註)

		發明專利說明書	475276
_	中文	氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件	
發明名稱	英文		
	姓名	1. 何晉國 2. 潘錫明 3. 邱建嘉	
二、 餐明人	姓 名 (英文)	1.Jin-Kuo HO 2.Shyi-Ming PAN 3.Chien-Chia CHIU	
	國 籍	1. 中華民國 2. 中華民國 3. 中華民國	
1	注、居所	 台北市光復北路60 巷19-10號2樓 彰化縣和美鎮孝慈路39巷3號 台北市民權東路三段184巷1號6樓 	
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 財團法人工業技術研究院	
	姓 名 (名稱) (英文)	1. Industrial Technology Research Institute	
-	國 籍	1. 中華民國	
三、 自 (主、居所 事務所)	1. 新竹縣竹東鎮310中興路四段195號	
	代表人姓 名(中文)	1. 林信義	
	代表人 姓 名 (英文)	1.	

本案已向	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
國(地區)申請專利	申請日期	案號	主張優先權
		無	
有關微生物已寄存於		寄存日期	寄存號碼
·		無	
			•

四、中文發明摘要 (發明之名稱:氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件)

一種氮化鎵(GaN)系列III-V族半導體發光元件(LED),將一p電極與一n電極設計於一n型透明半導體基板的不同面,且該p電極為一反射鏡電極(mirrorelectrode)用以反射該發光元件所產生的光,因此可簡化製程,並同時增加該發光元件的發光效率。另外,該n型透明半導體基板之側面可為傾斜面,且該n型半導體基板的一電極接觸面以及該側面可為粗糙化之表面,如此可減少該GaN LED的內部全反射,亦可提高發光效率。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



五、發明說明 (1)

【發明之應用領域】

本發明係關於氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,特別是關於一種p電極及n電極分別在基板兩面的氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件。

【發明背景】

現今的氮化鎵系列發光二極體(GaN LED)元件的結 構 , 除 了 Cree 公 司 是 使 用 S i C 當 基 板 外 , 其 餘 幾 乎 都 是 採 用不具導電性的藍寶石(Sapphire)作為基板的材料。由 於SiC 基 板 的 價 格 十 分 昂 貴 , 且 以SiC 基 板 所 製 作 的GaNLED ,在亮度上也不如以Sapphire基板為主的GaN LED,使 得SiC基板的GaN LED不如Sapphire基板的GaN LED普遍。 然 而 以Sappire 為 基 板 的GaN LED 仍 存 在 相 當 多 的 缺 點 , 例 如, GaN與Sapphire 的晶格常數差異性大,所生長的磊晶 層缺陷多,品質不易控制造成製程上的困難。且由於 Sapphire基板不導電,所以p電極與n電極必須做在基板的 同一面,也增加了製程的複雜性。另Sapphire基板的硬度 太高,不利於晶粒的切割,亦造成製程的因難度。另一方 面 ,以Sapphire 為 基 板 的GaN LED 為 了 增 加 發 光 面 積 必 須 採取覆晶(Flip Chip)的封裝方式,而為了降低覆晶封 裝時對準上的困難度,並且避免短路(short circuit) 發生,而必須增加晶粒的面積,使得每一晶片的總晶粒數 減少。

此外,傳統GaN LED當電流注入元件時,無法在D型半導層中進行均勻地擴散,發光區域被局限於金屬電極的四





五、發明說明(2)

周,而不透明的金屬電極又會造成光的遮蔽,因此造成 GaN LED 發光效率無法提昇。為了解決與p型GaN半導體層 接觸電極的應用問題,一般的解決方法均著重在該金屬電 極材料的選擇上、熱處理條件的改變以及電極製作方式的 改善等方面。

「 第1 圖 」 繪 示 一 種 習 知 的 Ga N LED 元 件 的 結 構 剖 面 示 意圖。該GaN LED元件包括: -Sapphire基板1;成長於該 Sapphire 基板1之一表面上的GaN半導體元件結構之磊晶層 2,以及在該磊晶層2上的一N電極3和一薄金屬D電極4。而 該磊晶層2係至少由一n型氮化鎵(n-GaN)半導體層5以及 一p型氮化鎵(p-GaN)半導體層6所組成。在該薄金屬p電 極4上則可形成有一範圍較小的金屬墊7(bonding pad)。以薄金屬層作為透明電極雖然可達到光穿透效果,但 其透光率仍受到限制,而會對光的輸出造成些許的阻擋, 降低元件的發光效率。且薄金屬層結構的總厚度要低於數 百埃,甚至要到100埃以下,才能達到透光效果。然而, 製作如此薄的金屬結構作為透明電極,會造成製程上的困 難 , 使 生 產 良 率 無 法 提 昇 。 此 外 , 該 薄 金 屬 層 的 厚 度 均 匀 性不易精準控制,發光的均勻性亦受到限制。另外,該薄 金屬易與環境中的水氣反應而劣化,降低元件的壽命與可 靠 度 。 因 此 必 須 額 外 的 鈍 態 保 護 層 8 以 保 護 該 薄 金 屬 電 極。如此,亦增加了製程的複雜性以及生產的成本。綜上 所述,仍有必要對GaN LED元件提出進一步的創新與改 良。





五、發明說明 (3)

【發明之目的及概述】

據此,本發明的目的仍是為了以提昇發光效率,降低製程困難度,而提供一種新的GaN LED 元件的結構。

根據上述目的,本發明的一種GaN LED元件,將一D電極與一n電極設計於基板的不同面,且該D電極為一反射鏡電極 (mirror electrode),因而可簡化製作流程並提昇發光效率。該GaN LED元件包括:一n型透明半導體基板,其具有一磊晶面以及一電極接觸面;一半導體元件結構,成長於該n型透明半導體基板之該磊晶面上,該半導體元件結構至少由一n型氮化鎵系列III-V族化合物半導體以及一p型氮化鎵系列III-V族化合物半導體所組成;一p透明接觸電極膜,形成於該半導體形成低電阻歐姆接觸;一反射鏡金屬D電極,形成於該p透明接觸電極膜上;以及,一金屬n電極,形成於該電極接觸面上。

其中該p型氮化鎵系列III-V族化合物半導體之最外層可包括一p型 $Al_xGa_yIn_zN/Al_pGa_qIn_rN$ 超晶格半導體,其中 $0\le x,y,z,p,q,r\le 1$,x+y+z=1,p+q+r=1, $Al_xGa_yIn_zN$ 的能際大於 $Al_pGa_qIn_rN$,且最外層為AlpGaqInrN。如此可直接與該反射鏡p電極形成良好的低電阻歐姆接觸,而可不需要該p透明接觸電極膜。

根據上述本發明的目的,該N型透明半導體基板之側面可具有傾斜面,亦即該側面有部份或全部之面傾斜於該N型透明半導體基板之該磊晶面與該電極接觸面。另外,





五、發明說明(4)

該電極接觸面與該側面可為粗糙化之表面,如此可減少全反射,而提高發光效率。

為使對本發明的目的、構造特徵及其功能有進一步的瞭解,茲配合圖示詳細說明如下:

【實施例詳細說明】

參考「第2A圖」,繪示根據本發明的一種GaN LED元 件的結構。該GaN LED元件主要由一透明導電基板11、一 半導體元件結構12、一p透明接觸電極膜13、一反射鏡p電 極14以及一金屬П電極15所組成。在本實施例中,該透明 導 電 基 板 1 1 為 一 n 型 G a N 導 電 基 板 , 用 以 當 作 窗 戶 層 (window layer)。然而該透明導電基板11亦可選用其它 的材質,例如,n-Zn0、n-SiC、 $n-LiAlO_2$ 、 $n-LiGaO_2$ 等。 該透明導電基板11具有一磊晶面111及一電極接觸面112。 該 半 導 體 元 件 結 構 1 2 係 磊 晶 成 長 於 該 磊 晶 面 1 1 1 上 , 而 該 金屬n電極15則形成於該電極接觸面112上,作為對外電性 連接之用,該金屬n電極15的材質可包括Au或Al等。該電 極接觸面112並可具有一N透明導電膜16,例如為一ITO透 明導電膜,該ITO透明導電膜具有良好的透光性,且可與 n-GaN 基 板 形 成 良 好 的 歐 姆 接 觸 , 接 觸 電 阻 率 可 低 至 $5 \times$ $10^{-4} \Omega$ (J.K. Sheu et al, "Indium tin oxide ohmic contact to highly doped n-GaN", Solid-State Electronics, Vol. 43, 1999, pp. 2081-2084) .

成長於該磊晶面111的該半導體元件結構12至少包括 一n型氮化鎵(GaN)系列III-V族化合物半導體121(以下





五、發明說明 (5)

簡稱為n型氮化物半導體)以及一p型氮化鎵(GaN)系列III-V族化合物半導體122(以下簡稱為p型氮化物半導體)。該p透明接觸電極膜13,例如為NiO或NiO/Au,係形成於該p型氮化物半導體122上,可與該p型氮化物半導體122形成良好的歐姆接觸,使電流均勻擴散至整個p型氮化物半導體層表面,並具良好的透光性(何晉國,鍾長祥,鄭振雄,黃兆年,陳金源,邱建嘉,史國光,"半導體之歐姆接觸及其製作方法",中華民國專利,公告第386286號)。

該反射鏡p電極14,例如為Ag或Al電極,形成於該p透明接觸電極膜13上,用以反射該GaN LED所產生的光線,藉由該p透明接觸電極膜13以及該反射鏡p電極14可有效增加該GaN LED的發光效率。且該反射鏡p電極14與該金屬n電極15在不同面,更可簡化製程與降低生產成本。

另外,如「第2B圖」所示,若該p型氮化物半導體122之最外層具一p型Al_xGa_yIn_zN/Al_pGa_qIn_rN超晶格半導體,其中 $0 \le x$, y, z, p, q, $r \le 1$, x+y+z=1, p+q+r=1, Al_x Ga_yIn_zN的能隙大於Al_pGa_qIn_rN,且最外層為Al_pGa_qIn_rN。則該p型氮化物半導體122可直接與該反射鏡p電極14形成良好的低電阻歐姆接觸,而可不需要在該反射鏡p電極14與該p型氮化物半導體122之間形成該p透明接觸電極膜。

参考「第3圖」為本發明的另一個實施例,該透明導電基板11的該電極接觸面112可加以粗糙化,平均粗糙度≥300埃,以減少內部全反射而增加發光效率。其中該電極接觸面112的粗糙化可以是無序的(random)亦可有一





五、發明說明 (6)

定的紋理(texture)。另外,如「第4圖」所繪示,該粗 糙化的電極接觸面112上,同樣地可形成有一n透明導電膜 16。

参考「第5A、5B圖」為本發明的另兩個實施例,該透明導電基板11的側面123可具有傾斜面,亦即該側面123之部份或全部可與該電極接觸面112及該磊晶面111不為重直而呈傾斜之角度,該傾斜面不限定為平面,亦可為曲面,使該透明導電基板11呈上窄下寬的形狀。如此,同樣地可可該透明導電基板11呈上窄下寬的形狀。如此,同樣地可可於部全反射的機率而增加光穿透的機會。另外,如「第6圖」所示,該電極接觸面112亦可加以粗糙化,而該粗糙化後的電極接觸面上,亦可形成一n透明導電膜16。另該n透明導電膜16可如「第7、8圖」所繪示,延伸至該透明導電基板11的側面113。

又參考「第9圖」所繪示之GaN LED元件結構。該透明導電基板11的側面113為傾斜面,且該電極接觸面112大於該磊晶面111,使該透明導電基板11呈上寬下窄的形狀。同樣地可減少內部全反射而增加發光效率。而該電極接觸面112同樣可加以粗糙化,亦可形成該n透明導電膜16而如「第10圖」中所繪之結構。

以上所述者,僅為本發明其中的較佳實施例而已,並非用來限定本發明的實施範圍,熟習該項技術者當可作適當的修飾與更改,例如,該金屬N電極除了可為Au、Al外,亦可為Pt、Pd、Ag、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V、Nb、





五、發明說明 (7)

Ta、Cr、Mo、Cu。而該反射鏡p電極可為Ag、Al 以外的材質,如Mg、Pt、Pd、Au、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V 、Nb、Ta、Cr 、Mo等。另外,可與該p型GaN 半導體形成良好歐姆接觸的透明導電膜,除了NiO外,亦可選用MnO、FeO、CoO、PdO 、 MoO_2 、 MnO_2 、 Fe_2O_3 、 Co_3O_4 、 Cr_2O_3 、 CrO_2 、 Rh_2O_3 、 $CuA1O_2$ 、 $SrCu_2O_2$ 。而可與該n型透明半導體基板形成良好歐姆接觸的透明導電膜除了ITO 外,亦可選用ZnO 、 SnO_2 、 In_2O_3 、 Tl_2O_3 、CdO 、 $In_4Sn_3O_{12}$ 、 $ZnSnO_3$ 、 $SnZn_2O_4$ 、 $Zn_2In_2O_5$ 、 $ZnGa_2O_4$ 、 $CdSb_2O_6$ 、 $GaInO_3$ 、 $MgInO_4$ 、 $AgInO_2$ 、 MIn_2O_4 (M=Mg 、Ca 、Sr 、Ba)等材質。故凡依本發明申請專利範圍所作的均等變化與修飾,皆為本發明專利範圍所



圖式簡單說明

【圖式簡單說明】

- 第1圖,繪示一種習知的GaN LED發光元件剖面示意圖,該發光元件的p電極與n電極在基板的同一面,且該p電極為薄金屬電極。
- 第2A圖,繪示根據本發明的一種GaN LED發光元件剖面示意圖,該發光元件的p電極與n電極在基板的不同面,且該p電極為一反射鏡電極,位於該發光元件的p型GaN半導體層上並形成有一p透明接觸電極膜。
- 第2B圖,繪示根據本發明的一種GaN LED發光元件剖面示意圖,該反射鏡p 電極直接形成於該發光元件的p 型GaN 半導體層之 $Al_xGa_yIn_zN/Al_pGa_qIn_rN$ 超晶格半導體表面上。
- 第3圖,繪示根據本發明的一種GaN LED發光元件剖面示意圖,該透明導電基板的電極接觸面被粗糙化。
- 第4圖,繪示根據本發明的一種GaN LED發光元件剖面示意圖,該透明導電基板的電極接觸面被粗糙化,其上並形成有一n透明導電膜。
- 第5A、5B圖,繪示根據本發明的GaN LED發光元件剖面示意圖,該透明導電基板的側面具有傾斜面,且電極接觸面小於磊晶面。
- 第6圖,為「第5A圖」所示之GaN LED發光元件的該電極接觸面加以粗糙化,其上並形成一n透明導電膜。
- 第7圖,為「第5A圖」所示之GaN LED 發光元件的該電極接



圖式簡單說明

觸面上形成有n透明導電膜且延伸至該透明導電基板的側面。

- 第8圖,為「第7圖」所示之GaN LED發光元件的該透明導電基板的電極接觸面與側面被粗糙化。
- 第9圖,繪示根據本發明的一種GaN LED發光元件剖面示意圖,該透明導電基板的側面為傾斜面,且電極接觸面大於磊晶面。
- 第10圖,為「第9圖」所示之GaN LED發光元件的該透明導電基板的電極接觸面被粗糙化,其上並形成有一n透明導電膜。

【圖式符號說明】

- 1 Sapphire 基 板
- 2 磊晶層
- 3 n電極
- 4 薄金屬p電極
- 5 n型氮化鎵半導體層
- 6 p型氮化鎵半導體層
- 7 金屬墊
- 8 保護層
- 11 透明導電基板
- 12 半導體元件結構
- 13 p透明接觸電極膜
- 14 反射鏡D電極
- 15 金屬n電極



圖式簡單說明

- 16 n透明導電膜
- 111 磊晶面
- 112 電極接觸面
- 113 側面
- 121 n型氮化物半導體
- 122 p型氮化物半導體

- 1. 一種氮化鎵系列[[]-V族化合物半導體發光元件包含:
 - 一n型透明半導體基板,具有一磊晶面以及一電極接觸面;
 - 一半導體元件結構,成長於該N型透明半導體基板之該磊晶面上,該半導體元件結構至少由一N型氮化鎵系列III-V族化合物半導體以及一P型氮化鎵系列III-V族化合物半導體所組成;
 - 一p透明接觸電極膜,形成於該半導體元件結構上, 並與該p型氮化鎵系列III-V族化合物半導體形成低 電阻歐姆接觸;
 - 一反射鏡金屬p電極,形成於該p透明接觸電極膜上; 以及
 - 一金屬1電極,形成於該電極接觸面上。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物 半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極 接觸面上,並具有一n透明導電膜,該n透明導電膜與該 n型透明半導體基板形成低電阻歐姆接觸。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物 半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之材質係 選自n-GaN、n-ZnO、n-SiC、n-LiAlO₂、n-LiGaO₂所組成 之族群中的任何一種。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物 半導體發光元件,其中該半導體元件結構至少具有一組 p-n junction。



- 5. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物 半導體發光元件,其中該p透明接觸電極膜為p型氧化物 半導體(p-type metal oxide semiconductor)或是p 型氧化物半導體與貴金屬(noble metal)混合材料。
- 6. 如申請專利範圍第5項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該p型氧化物係選自Mn0、Fe0、Co0、Ni0、Pd0、Mo 0_2 、Mn 0_2 、Fe $_2$ 0 $_3$ 、Co $_3$ 0 $_4$ 、Cr $_2$ 0 $_3$ 、Cr 0_2 、Rh $_2$ 0 $_3$ 、CuAl0 $_2$ 、SrCu $_2$ 0 $_2$ 等所組成之族群中的任何一種。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該金屬p電極係選自Au、A1、Mg、Pt、Pd、Ag、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、所組成之族群中的任何一種。
- 8. 如申請專利範圍第2項所述之氮化鎵系列III-V族化合物 半導體發光元件,其中該n透明導電膜為透明導電氧化 物。
- 9. 如申請專利範圍第8項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該透明導電氧化物係選自ITO、ZnO、 SnO_2 、 In_2O_3 、 Tl_2O_3 、CdO、 $In_4Sn_3O_{12}$ 、 $ZnSnO_3$ 、 $SnZn_2O_4$ 、 $Zn_2In_2O_5$ 、 $ZnGa_2O_4$ 、 $CdSb_2O_6$ 、 $GaInO_3$ 、 $MgInO_4$ 、 $AgInO_2$ 、 MIn_2O_4 (M=Mg、Ca、Sr、Ba)等所組成之族群中的任何一種重攙雜之n型半導體氧化物。
- 10. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該金屬n電極係選自Ag、Al、





Pt、Pd、Au、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、Cu所組成之族群中的任何一種。

- 11.如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面可全部或部份粗糙化,平均粗糙度≥300埃。
- 12. 如申請專利範圍第1項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之側面具有傾斜面。
- 13. 如申請專利範圍第12項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面大於該磊晶面。
- 14. 如申請專利範圍第12項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面小於該磊晶面。
- 15. 如申請專利範圍第14項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面與該側面可全部或部份粗糙化,平均粗糙度≥300埃。
- 16. 如申請專利範圍第14項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面上,並具有一n透明導電膜,該n透明導電膜與該n型透明半導體基板形成低電阻歐姆接觸。
- 17. 如申請專利範圍第16項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n透明導電膜延伸至該n型透



明半導體基板之該側面。

- 18. 一種氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,包括:
 - 一n型透明半導體基板,具有一磊晶面以及一電極接觸面;
 - 一半導體元件結構,成長於該N型透明半導體基板之該磊晶面上,該半導體元件結構至少包含:
 - 一 n 型 氮 化 鎵 系 列 I I I V 族 化 合 物 半 導 體 ; 以 及
 - 一p 型 氮 化 鎵 系 列 I I I V 族 化 合 物 半 導 體 , 其 外 層 具 一 p 型 A 1_x G a_y I n_z N / A 1_p G a_q I n_r N 超 晶 格 半 導 體 , 其 中 $0 \le x$, y, z, p, q, r ≤ 1 , x+y+z=1 , p+q+r=1 , A 1_x G a_y I n_z N 的 能 隙 大 於 A 1_p G a_q I n_r N , 且 最 外 層 為 A 1_p G a_q I n_r N ;
 - 一反射鏡金屬p 電極,形成於該p 型 $A\,l_x\,G\,a_y\,I\,n_z\,N/A\,l_p\,G\,a_q\,I\,n_r\,N\,$ 超晶格半導體之該最外層 $A\,l_o\,G\,a_o\,I\,n_r\,N\,$ 表面上;以及
 - 一金屬N電極,形成於該電極接觸面上。
- 19. 如申請專利範圍第18項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面上,並具有一n透明導電膜,該n透明導電膜與該n型透明半導體基板形成低電阻歐姆接觸。
- 20. 如申請專利範圍第18項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之材質係選自n-GaN、n-ZnO、n-SiC、n-LiA1O2、n-LiGaO2所組





成之族群中的任何一種。

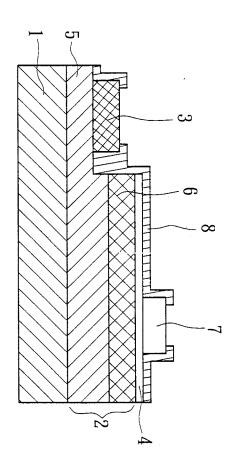
- 21. 如申請專利範圍第18項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該半導體元件結構至少具有一組p-n junction。
- 22. 如申請專利範圍第18項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該反射鏡金屬p電極係選自Ag、Al、Mg、Pt、Pd、Au、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、所組成之族群中的任何一種。
- 23. 如申請專利範圍第19項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n透明導電膜為透明導電氧化物。
- 24. 如申請專利範圍第23項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n透明導電氧化物係選自ITO、ZnO、 SnO_2 、 In_2O_3 、 $T1_2O_3$ 、CdO、 $In_4Sn_3O_{12}$ 、 $ZnSnO_3$ 、 $SnZn_2O_4$ 、 $Zn_2In_2O_5$ 、 $ZnGa_2O_4$ 、 $CdSb_2O_6$ 、 $GaInO_3$ 、 $MgInO_4$ 、 $AgInO_2$ 、 MIn_2O_4 (M=Mg、Ca、Sr、Ba)等所組成之族群中的任何一種重攙雜之n型半導體氧化物。
- 25. 如申請專利範圍第18項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該金屬n電極係選自Au、Al、Pt、Pd、Ag、Co、Ni、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、Cu所組成之族群中的任何一種。
- 26. 如申請專利範圍第18項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面可全部或部份粗糙化,平均粗糙度≥300埃。



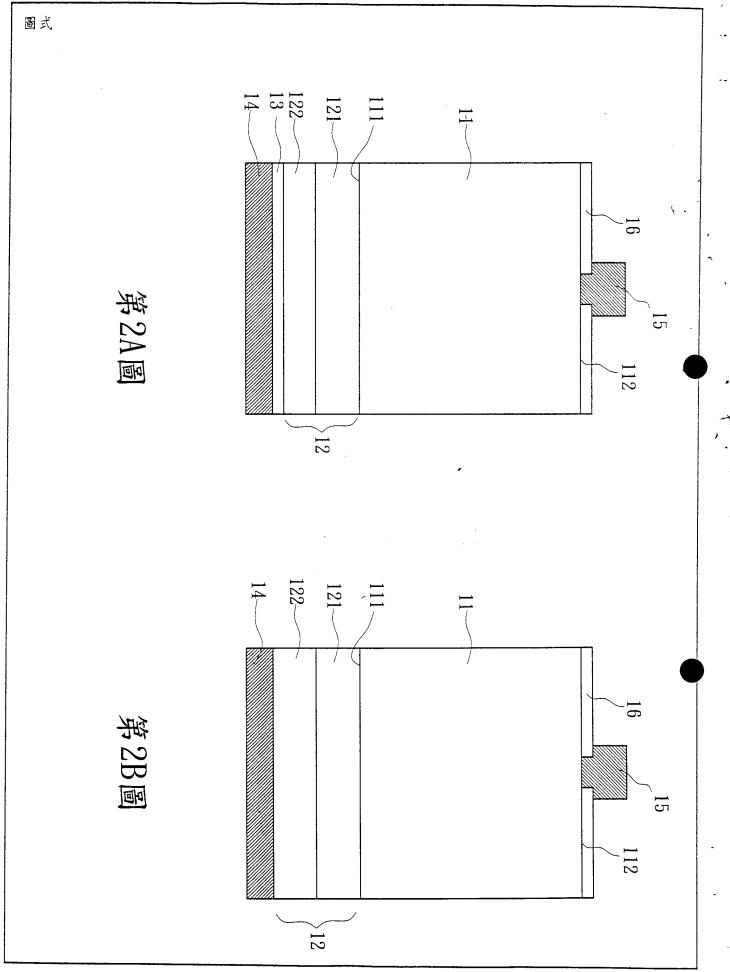


- 27. 如申請專利範圍第18項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之側面具有傾斜面。
- 28. 如申請專利範圍第27項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面大於該磊晶面。
- 29. 如申請專利範圍第28項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面小於該磊晶面。
- 30. 如申請專利範圍第29項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面與該側面可全部或部份粗糙化,平均粗糙度≥300埃。
- 31. 如申請專利範圍第29項所述之氮化錄系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n型透明半導體基板之該電極接觸面上,並具有一n透明導電膜,該n透明導電膜與該n型透明半導體基板形成低電阻歐姆接觸。
- 32. 如申請專利範圍第31項所述之氮化鎵系列III-V族化合物半導體發光元件,其中該n透明導電膜延伸至該n型透明半導體基板之該側面。





画[宪



第2/頁

